

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 11 月 24 日 (24.11.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/112008 A1

(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: G11B 5/31, 5/39

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/008792

(22) 国際出願日: 2005 年 5 月 13 日 (13.05.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願2004-146493 2004 年 5 月 17 日 (17.05.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 NEOMAX (NEOMAX CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5410041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目 7 番 1 9 号 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 廣岡 泰典 (HIROOKA, Taisuke) [JP/JP]; 〒6570816 兵庫県神戸市灘

区国玉通 1-2-19 Hyogo (JP). 坪田 広信 (TSUBOTA, Hironobu) [JP/JP]; 〒6158191 京都府京都市西京区川島有栖川町 2 0 Kyoto (JP).

(74) 代理人: 奥田 誠司 (OKUDA, Seiji); 〒5410041 大阪府大阪市中央区北浜一丁目 8 番 1 6 号 大阪証券取引所ビル 10 階 奥田国際特許事務所 Osaka (JP).

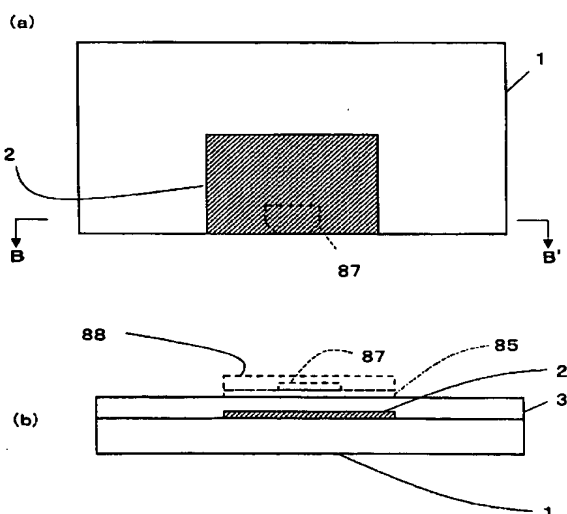
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,

[続葉有]

(54) Title: SUBSTRATE FOR THIN FILM MAGNETIC HEAD AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 発明の名称: 薄膜磁気ヘッド用基板およびその製造方法



(57) Abstract: Disclosed is a substrate for a thin film magnetic head comprising a ceramic substrate (1) having a major surface and an undercoat film (3) covering the major surface of the ceramic substrate. An electric/magnetic transducer is formed on the undercoat film. This substrate for a thin film magnetic head further comprises an intermediate layer (2) which is formed between the major surface of the ceramic substrate and the undercoat film. This intermediate layer (2) is composed of a material other than the aluminum oxide, and is so patterned as to have a part of the major surface of the ceramic substrate in direct contact with the undercoat film.

(57) 要約:

本発明の薄膜磁気ヘッド用基板は、主面を有するセラミックス基板 (1) と、前記セラミックス基板の主面を覆うアンダーコート膜 (3) とを備え、前記アンダーコート膜上に電気/磁気トランスデューサ素子が形成される薄膜磁気ヘッド用基板であって、前記セラミックス基板の主面およびアンダーコート膜の間に形成された中間層 (2) を更に備えており、前記中間層は、前記アルミニウム酸化物以外の物質から形成され、しかも、前記セラミックス基板の主面の一部を前記アンダーコート膜と直接に接触させるようにパターンニングされている。



BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,  
IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),  
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,  
MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される  
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語  
のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書